**Mitutoyo WLI ist nominiert für den Inspect Award**

**Weißlichtinterferometer (WLI)**

Mit der WLI-Einheit und einer breiten Palette von Interferenzoptiken aus eigener Entwicklung und Fertigung ermöglicht Mitutoyo den zuverlässigen und robusten industriellen Einsatz eines hochgenauen Sensors.  
  
Die Anforderungen an die Messtechnik hinsichtlich Genauigkeit, Auflösung und Geschwindigkeit nehmen stetig zu. Die berührungslose Erfassung von Oberflächen mit Höhenunterschieden im Nanometerbereich wird immer häufiger gefordert, um auch kleinste Topografien oder Rauheiten auswerten zu können.

Mit der WLI-Einheit und einer breiten Palette von Interferenzoptiken aus eigener Entwicklung und Fertigung ermöglicht Mitutoyo den zuverlässigen und robusten industriellen Einsatz eines hochgenauen Sensors, der diese Anforderungen erfüllt. Die kompakte Bauform und die umfangreiche Programmierschnittstelle bieten eine hohe Flexibilität und ermöglichen es, diese Technologie in eigene Systeme zu integrieren und damit Anwendern zur Verfügung zu stellen.

Um die Grenzen des messtechnisch Erfassbaren immer weiter zu verschieben, macht sich die optische Messtechnik die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften des Lichts zunutze. Ein Weißlichtinterferometer nutzt die Wellennatur des Lichts aus, um Höhenunterschiede mit einer Auflösung im Nanometerbereich mit einem Flächensensor zu erfassen. Dies eröffnet Möglichkeiten bei der Auswertung mikroskopischer Topografien und der berührungslosen Rauheitsmessung in zahlreichen Anwendungsumgebungen.

**Die Abstimmung ist bis einschließlich 31. Mai 2025 möglich.**

Zur Abstimmungsseite: [www.inspect-award.de](http://www.inspect-award.de)